

干式氦检漏仪 UL5000

移动式 UL5000 干式氦检漏仪符合最严格的半导体应用要求，提供快速的抽空时间和快的响应时间。

它是测试容积 > 50 升的理想测试工具。



用户优越性

- 跨越 15 个量级的宽测量范围
- 短的抽空和响应时间
- 可移动的全金属外壳, 具有无比的便利性与可操作性
- 软件程序 **HYDRO-S** (氢 - 抑制) 可快速地达到测试条件
- **I-CAL** (漏率的智能计算程序) 确保在全部测量范围内最快速的响应时间
- 带自动集成时间对准的抑零功能用于快速与可靠的测试结果
- 带耐用的涡卷泵和多进气口涡轮分子泵的智能真空设计 提供高的氦抽速和高压缩比
- 可旋转的显示器和用户界面, 可简易地控制和与仪器交流
- 自保护功能, 避免 UL5000 受到氦或微粒的污染
- 自动冲净周期确保清理和准备测试
- 软件更新简易地通过电子邮件
- 最新的工作台机构带有最佳化高度的工作面, 它包含 ESD 垫和可锁的工具箱
- 耐用质谱仪系统的双灯丝离子源 (3 年保用期) 保证长的运行时间和低的维护费用
- 内置的测试漏孔用于内部校准保证精确的测试结果
- 可选的运距控制用于有线 (远至 28 米) 或无线 (远至 100 米), 用 3.5" 全彩色的触摸屏显示器操作 (见第 20 页)

典型用途

- 试漏:
 - 元件
 - 大型工艺室 (> 50 升容积)
 - 次组装件
- 用于
 - 半导体工艺程序
 - 平板显示器工艺程序

技术规范		UL5000
最小可检氦漏率 (真空模式) *)		< 5 x 10 ⁻¹² 毫巴·升/秒
最小可检氦漏率 (吸枪模式) *)		< 5 x 10 ⁻⁸ 毫巴·升/秒
最大可检氦漏率, 可显示的		0.1 毫巴·升/秒
最大进气口压强	GROSS 模式: FINE 模式: ULTRA 模式:	15 毫巴 2 毫巴 0.4 毫巴
在抽空过程中的抽速		25 米 ³ /小时 (17.6 呎 ³ /分), 50 Hz 30 米 ³ /小时 (21.1 呎 ³ /分), 60 Hz
氦抽速	GROSS 模式: FINE 模式: ULTRA 模式:	最大 8 升/秒 7 升/秒 2.5 升/秒
漏率讯号的时间常数 (盲住, 63%最终值)		< 1 秒
抽空时间,直到准备检漏 (本底 5 x 10 ⁻⁹)		
无附加容积		<10 秒
测试容积 10 升		<48 秒
测试容积 50 升		<150 秒
响应时间 (漏率 10 ⁻⁹ 毫巴·升/秒)		
容积高至 10 升		< 1 秒
容积高至 50 升		< 2 秒
放空 (测试容积 100 升)		约 25 秒
直到仪器作好运行准备的时间		< 3 分
可检质量数		2,3,4 amu, H ₂ , ³ He, He
质谱仪		180°扇形磁场
离子源		2 根,敷涂氧化铱/钪灯丝
校准漏孔 TL7 (内置)漏率范围		10 ⁻⁷ 毫巴·升/秒
测量单位		毫巴·升/秒, 帕·米 ³ /秒, 毛·升/秒, 大气压·毫升/秒, ppm, 克/年 (仅吸枪模式)
测试口		25 KF
可调整的触发点		2
接口		RS 232
输入/输出		PLC 兼容,用于控制和状态信息
图形记录仪输出		2 x 10 伏
电源电压		230 伏 (±10%) 50 Hz 115 伏 (±10%) 60 Hz 100 伏 (±10%) 50/60 Hz
功耗		1200 伏安
尺寸 (长 x 宽 x 高)		1080 x 530 x 1083 毫米 (42.5 x 21 x 42.6 吋)
重量		140 公斤 (308 磅)
保护类型		IP 20
允许环境温度 (运行中)		+10 °C+40 °C
*)按 AVS 和 EN 1518 标准		
订货资料		订货号
UL5000, 230 伏, 50 Hz, EU 电源插头		550-500A
UL5000, 100/115 伏, 50/60 Hz, US 电源插头		550-501A
全部 UL5000 包含工具箱和 ESD 垫		
C1000C 运距控制, 有线, 包含 4 米盘绕电缆		551-010
RC1000WL 运距控制, 无线, 包含无线传送器		551-015
无线传送器用于连接 > 2 检漏仪		551-020
延伸电缆, 8 米用于 RC1000C		140 22
Accessories:		
氦瓶支座		551-001
LeakWare PC 软件包		140 90
吸枪管线 SL200, 4 米		140 05
缩径件 40/25 KF, 将 SL200 连接 UL5000 进气口		211-283